

<i>Григорчак І.І., Іващишин Ф.О., Григорчак О.І., Матулка Д.В.</i> Інтеркалатні наноструктури з ієрархічною супрамолекулярною архітектурою: отримання, властивості, застосування	284
<i>Мизерник В.Н., Шматько А.А.</i> Определение материальных параметров и толщины промышленных магнитодиэлектрических и ферритовых образцов с металлической подложкой	293
<i>Аксёнов Д.С., Аксёнов И.И., Лучанинов А.А., Решетняк Е.Н., Стрельницкий В.Е.</i> Регулировка состава Ti-Al-N покрытий, осаждаемых с применением двухканального вакуумно-дугового источника фильтрованной плазмы	307
<i>Береснев В.М., Турбин П.В., Ковалева М.Г., Колесников Д.А., Маликов Л.В., Грудницький В.В., Стадник Ю.С., Букальцева Ю.С.</i> Адгезионная прочность нанокompозитных покрытий Zr-Ti-Si-N, полученных вакуумно-дуговым методом	314
<i>Григорчак І.І., Войтович С.А.</i> Квантова ємність та процеси накопичення заряду в наноструктурах з почерговими 2D-електронними і 2D-іонними прошарками	320
<i>Лонин Ю.Ф., Пономарев А.Г., Уваров В.В., Уваров В.Т., Базалеев Н.И., Донец С.Е., Клепиков В.Ф., Литвиненко В.В., Прохоренко Е.М.</i> Кавитационная стойкость металлических покрытий, наплавленных сильно-точным релятивистским электронным пучком	326
<i>Tabatadze I.G., Jabua Z.U., Gigineisvili A.V., Kupreisvili I.L.</i> Preparation of terbium monol-fide thin crystalline film	333
<i>Сагалович А.В., Кононихін А.В., Попов В.В., Дуднік С.Ф., Сагалович В.В.</i> Установка AVINIT для нанесення багатошарових функціональних покриттів	336
<i>Погребняк А.Д., Мухаммед А.А-К.М., Букальцева Ю.С.</i> Структура и свойства покрытий из ZnO	348
<i>Борисенко Ю.Н., Береснев В.М., Литовченко С.В., Шевцов А.Б.</i> Пограничное газовыделение в тонкопленочной системе под действием протонного облучения и возможности его применения	353
<i>Ахмадалиев Б.Ж., Каримов М.А., Полвонов Б.З., Юлдашев Н.Х.</i> Низкотемпературная фотолуминесценция тонких пленок CdTe, CdTe:In с аномальным фотовольтаическим свойством	358
<i>Атакулов Ш.Б., Зайнолобидинова С.М., Отажонов С.М., Тухтаматов О.А.</i> Особенности рассеяния носителей тока межкристаллитными потенциальными барьерами, образованными электронными поверхностными состояниями в поликристаллических полупроводниках	365
<i>Храновська К.М., Мазанко В.Ф., Іващенко Є.В., Лобанова Г.Г.</i> Вплив середовища легування та додаткового азотування на мікротвердість, структуру та фазовий склад залізної підкладки	371
<i>Правила оформления рукописей</i>	376
<i>Правила оформлення рукописів</i>	377
<i>Information for authors</i>	378